物体の硬さを検出できる多軸触覚センサに関する研究



Research on a tactile sensor that can measure object stiffness

[研究の目的]

高齢化社会に伴う介護・介助者不足を解決す るため、我々の生活を支援するロボットの実現 が期待されている。人と接触するロボットには 様々な機能が求められるが、中でも特に重要な のが力と物体の硬さを容易に計測できることで ある[1,2]。ロボットに搭載される力センサに は、小型であるのはもちろんのこと、ロボット が正しく動作するために単一のセンサで様々な 情報を得られることが求められる。また、ロ ボットが素早く動作するためには、センサ自身 が高速応答できるように、できるだけシンプル な計測原理に基づいていることが望ましい。

物体の硬さを評価する従来の方法では、物体 に押し付けたときの力と変位量を同時に計測す る必要があるため、装置の小型化が困難であり、 ロボットへの搭載が難しかった [3,4]。近年、 圧力とせん断力を同時に計測できる触覚センサ が盛んに研究開発されている。中でも MEMS 技術を用いた触覚センサは、小型・高感度と いった利点により、ロボットへの応用が期待さ れている。触感の中には物体の硬さの認識があ り、例えばロボットハンドによる物体の把持や 手術ロボットにおける患部の診断などで重要な 情報となる [5,6]。しかし、これまでの触覚セ ンサでは、物体の硬さを推定するために、物体 がどれだけ変形したかという情報が必要であっ



図1 (a) 提案したセンサの概要図 (b) 硬さの計測の原
理 (c) センサの設計パラメータ

た。

そこで本研究の目的はさわるだけで物体の硬 さを計測できる数 mm サイズの力センサを実 現することである。提案したセンサの構造を図 1 (a) に示す。センサチップの中央と両端に配 置される3つのピエゾ抵抗型カンチレバーと, これらを覆うゴムカバーで構成される。物体の 硬さの計測原理を図1(b) に示す。物体が柔 らかいほど中央のカンチレバーに比べて左右の



図2 シミュレーション結果

カンチレバーが大きく変形するため、両端のカ ンチレバーと中央カンチレバーの出力の比から 物体の硬さが求められる。センサチップの設計 パラメータを図1(c) に示す。チップのサイズ は3mm×3mm×0.3mm である。

[研究の内容,成果]

計測原理を検証するためにシミュレーション を行った。シミュレーションのモデルを図2 (a)に示す。センサの弾性体パッドのサイズは 4 mm×2 mm×1 mm であった。弾性体パッド に 10 kPa の加重を印加した。対象物のヤング 率を 10⁴ Pa から 10⁸ Pa の範囲に変えた。シ ミュレーション結果を図2(b) に示す。対象 物の硬さが高くなれば、パッドの中央とパッド の端に配置されたカンチレバーのひずみの比率 が小さくなったことがわかった。この結果から、 提案したセンサは物体に押し付けるだけで、物 体の硬さを推定できることが検証された。

センサの製作プロセスフローを図3に示す。 詳しいプロセスフローは [6] に報告された。試 作したセンサを図4に示す。センサチップのカ ンチレバーのサイズは 125 μ m×100 μ m×20 μ m であった。両面カプトンテープを用いて PDMS パッドをセンサチップに貼り付けた。

試作センサを用いて,異なる硬さのサンプル に対して実験を行った。実験の前に,サンプル



図3 センサの製作プロセスフロー





の準備及びサンプルのヤング率の計測を行った。 サンプルとして Urethane resin, PDMS を利用 した。リニアステージに取り付けたフォース

Materials	Young's modulus (kPa)
Urethane resin A	$(5.6 \pm 0.2) \times 10$
Urethane resin B	$(6.2\pm0.3) \times 10$
Urethane foam	$(8.2\pm0.1) \times 10$
PDMS A	$(3.5\pm0.7)\times10^2$
PDMS B	$(4.6\pm0.1)\times10^2$

Table 1 計測したサンプルの硬さ



図6 実験セットアップ

ゲージ (IMADA 社製, ZTS-50N) を各各サ ンプルに押し付けた。リニアステージの変位と フォースゲージで計測された押し付け力から各 サンプルの硬さを計算した。計測結果を Table 1 に示す。また, コントロールサンプルとして 準備したサンプルより十分硬いであるアクリル ブロックを利用した。

実験セットアップを図6に示す。各サンプル のサイズは図5(b)に示すように,長さ15 mm,幅15mm,高さ10mmにカットされた。 リニアステージを用いて,センサを一定の速度 (0.05 mm/s)で各サンプルに押し付けた。カ ンチレバーの抵抗変化率は計測回路で1000倍 に増幅された後,スコープコーダ(横河電機社 製,DL850)に記録された。

計測結果を図7に示す。各サンプルについて, センサチップの両端のカンチレバーの抵抗変化 率の平均値とセンサチップの中央に配置された カンチレバーの抵抗変化率との関係

を図7(a) に示す。サンプルが柔らかいほど,



図7 サンプルの硬さとセンサの出力との関係

中央のカンチレバーより両端のカンチレバーの 変化率が大きかったことがわかった。両端のカ ンチレバーの抵抗変化率の平均値と中央のカン チレバーの抵抗変化率との比率をrで定義し、 サンプルの硬さとrとの関係を図7(b)にしめ す。物体のヤング率が高くなれば、rが小さく なり、提案した計測原理と一致したことがわ かった。線形領域においてrは押し付け力に依 存しないため、押し付け力を計測しなくてもr から物体の硬さを求めることが可能である。

[今後の研究の方向,課題]

提案したセンサは小型であるにもかかわらず, 押し付け量の計測が不要であり,計測原理がシ ンプルなので,ロボットへの応用に適している。 これまでの実験では対象物の表面が平面に限ら れたが,今後は曲面や凹凸がある面に対しても 実験を行い,対象物の表面形状の影響を検証し ていきたい。また,さらにセンサを小さくし, ロボットハンドや手術冶具に取り付け,把持物 や患部の硬さを計測できることを検証していく 予定である。

[参考文献]

- H. Yousef, M. Boukallel, and K. Althoefer, "Tactile sensing for dexterous in-hand manipulation in robotics-A review", *Sensors and Actuators A*: *Physics*, pp. 171–187, 2011.
- [2] J. Tegin, and J. Wikander, "Tactile sensing in intelligent robotic manipulation", *Ind. Robot*, 32, pp. 64–70, 2005.
- [3] Y. R. Li, C. C. Su, W. J. Lin, and S. H. Chang, "Piezoelectric sensor to measure soft and hard stiffness with high sensitivity for ultrasonic transducers", *Sensors*, 15, pp. 13670–13679, 2015.
- [4] S.T. Szewczyk, W.Y. Shih, W. Shih, "Palpationlike soft-material elastic modulus measurement using piezoelectric cantilevers", *Review of Scientific Instruments*, 77, pp. 044302, 2006.
- [5] P. Valdastri, K. Houston, A. Menciassi, P. Dario, A. Sieber, M. Yanagihara, and M. Fujie, "Miniaturized cutting tool with triaxial force sensing capabilities for Minimally Invasive Surgery", ASME Journal of Medical Devices 1, pp. 206–211, 2007.
- [5] M. E. H. Eltaib, and J.R. Hewit, "Tactile sensing technology for minimal access surgery-a review", *Mechatronics*, 13, pp. 1163–1177, 2003.

[6] Ryota Tanii, Thanh-Vinh Nguyen, Tomoyuki Takahata and Isao Shimoyama, "Elasticity sensor using different tactile properties on one chip," *The* 31th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS2018), Belfast, Northern Ireland, pp. 862–865, Jan 21–25, 2018.

[成果発表]

プロシーディング

Ryota Tanii, <u>Thanh-Vinh Nguyen</u>, Tomoyuki Takahata and Isao Shimoyama, "Elasticity sensor using different tactile properties on one chip," *The* 31th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS2018), Belfast, Northern Ireland, pp. 862–865, Jan 21–25, 2018.

特許出願

下山勲,高畑智之,グェンタンヴィン,谷井涼太,"硬 さセンサおよび硬さセンサアレイ並びに硬さ検出方 法",特願 2018-006947

プレスリリース

http://www.leopard.t.u-tokyo.ac.jp/press/Final_ press_release_MEMS_v0123_for_website.pdf

報道

「チップ状の触覚センサー,東大,ロボットの手器用 に」,日経産業新聞,2018年2月13日